



(12) 发明专利
(扉页更正)

(48) 更正文献出版日 2019.08.20

(10) 授权公告号 CN 106536403 B8

(45) 授权公告日 2019.07.02

(21) 申请号 201580027564.7

(56) 对比文件

(22) 申请日 2015.07.10

US 2005/0000932 A1, 2005.01.06, 说明书第
31-36段, 附图9-13.

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

CN 101640977 B, 2013.04.24, 全文.

2016.11.25

CN 102074648 B, 2015.04.15, 全文.

(86) PCT国际申请的申请数据

审查员 杨靖

PCT/US2015/030158 2015.05.11

(87) PCT国际申请的公布数据

W02015/183534 EN 2015.12.03

(73) 专利权人 3M创新有限公司

地址 美国明尼苏达州

(72) 发明人 P·J·伯杰龙 B·D·伦塞弗德

J·D·盖辛格 D·B·冈德尔

J·A·莫奈伊 R·帕拉尼斯瓦米

符祥心

(74) 专利代理机构 北京市金杜律师事务所

11256

代理人 李辉 董典红

(51) Int. Cl.

B81B 3/00(2006.01)

B81C 1/00(2006.01)

权利要求书 2 页 说明书 13 页 附图 14 页

(54) 发明名称

柔性基底上的微机电系统装置

(57) 摘要

本发明描述了一种包括一个或多个 MEMS 元件的柔性膜, 以及包括所述柔性膜的制品。所述柔性膜包括在两个金属层之间的聚合物层, 其中所述金属层中的一者包括穿孔。所述聚合物层包括空隙区域, 从而允许所述两个金属层发生相对运动。

